

## Ptfe 웨이퍼 세척 바스켓 4인치 에칭 랙 산알칼리 내성 맞춤형 마스크 캐리어

품목 번호: PL-CP90



### 소개

반도체 웨이퍼 세척 및 화학 공정용으로 정밀 설계된 PTFE 에칭 바스켓입니다. 이 내산성 고순도 세척 랙은 까다로운 실험실 환경에서 오염을 완전히 방지합니다. 첨단 제조 및 연구 응용 분야의 특정 산업용 마스크 및 웨이퍼 크기에 맞춰 완전 맞춤 제작이 가능합니다.

### 자세히 알아보기

| 응용 분야     | 설명                                         | 주요 이점                                              |
|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 반도체 습식 에칭 | 박막 제거 또는 표면 세척을 위해 실리콘 웨이퍼를 산성 용액에 침지하는 공정 | HF 및 기타 공격적인 에칭제에 대한 완전한 내성으로 재료 분해가 전혀 발생하지 않습니다. |
| 포토마스크 세척  | 특수 화학 세척 및 린싱 공정에서 민감한 석영 마스크를 운반하는 공정     | 저충격 소재 접촉으로 복잡한 마스크 패턴의 표면 손상을 방지합니다.              |
| 태양전지 제조   | 텍스처링 및 도핑 세척 단계에서 광전지 웨이퍼를 처리하는 공정         | 높은 처리량 용량과 화학적 안정성으로 전반적인 제조 효율을 향상시킵니다.           |
| MEMS 공정   | 다양한 화학 에칭 환경에서 미세전자기계시스템을 처리하는 공정          | 정밀 슬롯 가공으로 교반 중 작고 깨지기 쉬운 부품을 안전하게 고정합니다.          |
| 미량 금속 분석  | 분석 테스트 전에 고순도 산소에서 실험 용기와 용기를 세척하는 공정      | 금속이 없는 세척 환경을 제공하여 교차 오염을 제거합니다.                   |
| 나노기술 연구   | 새로운 화학 용액 및 반응성 환경에서 실험 기판을 처리하는 공정        | 다양한 온도 및 화학 적합성의 다용성으로 다양한 연구 프로토콜을 지원합니다.         |

| 특징         | PL-CP90의 사양 세부 정보         |
|------------|---------------------------|
| 모델 번호      | PL-CP90                   |
| 소재 구조      | 고순도 PTFE (폴리테트라플루오로에틸렌)   |
| 웨이퍼 크기 호환성 | 4인치 (표준) / 완전 맞춤형 크기      |
| 슬롯 구성      | 맞춤형 슬롯 개수 및 피치 간격         |
| 화학 내성      | 산, 알칼리 및 용매에 대한 범용 내성     |
| 작동 온도 범위   | -200°C ~ +260°C           |
| 표면 처리      | 정밀 CNC 가공 / 초저 표면 조도      |
| 핸들 디자인     | 분리형 또는 고정형 스타일 제공 (맞춤 가능) |
| 배수 디자인     | 고유동 개방 프레임 형상             |
| 제조 방식      | 중단간 맞춤형 CNC 제조            |
| 주문 유형      | 고객 사양 기반 맞춤 제품            |